第 50 卷 第 20 期/2023 年 10 月/中国激光



# 激光增材制造 CoCrFeNi 高熵合金激光抛光工艺研究

周宇航<sup>1,2,3</sup>,张咪娜<sup>2\*</sup>,陈晓晓<sup>2\*\*</sup>,张群莉<sup>1,3</sup>,张文武<sup>2</sup>

1浙江工业大学机械工程学院,浙江杭州 310023;

<sup>2</sup>中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江省航空发动机极端制造技术研究重点实验室,浙江 宁波 315201; <sup>3</sup>浙江工业大学激光先进制造研究院,浙江 杭州 310023

摘要 激光增材制造技术可实现高熵合金零部件的快速制造,但增材件存在表面质量差、难加工等问题。对此,笔 者采用激光抛光工艺来改善CoCrFeNi高熵合金增材件的表面质量。首先通过筛选实验法和单因素实验法,研究 了激光功率、扫描速度、扫描间距、离焦量、扫描轨迹和扫描次数等因素对表面粗糙度的影响规律,而后探讨了激光 抛光对合金表面元素分布和微观组织的作用机制。结果表明:激光抛光技术可以有效降低增材件的表面粗糙度,离 焦量和激光功率对表面质量的影响相对较大,表面粗糙度随着扫描速度、离焦量、扫描次数的增加呈现先减小后增 大的趋势;经激光抛光后的高熵合金增材件表面O元素和Cr元素含量显著降低,Co元素、Fe元素及Ni元素含量略 有提升,表面粗糙度较初始表面粗糙度降低了约90%;连续激光对增材件表面的作用机制主要是重熔,对表层氧化 物的去除机制主要是汽化。

关键词 激光技术; 连续激光抛光; CoCrFeNi高熵合金; 表面粗糙度; 表面形貌 中图分类号 TN249 **文献标志码** A

#### **DOI:** 10.3788/CJL230616

# 1引言

高熵合金是由5种或5种以上元素按等原子比或 近等原子比组成的新型多组元合金,具有高强度、耐腐 蚀、抗疲劳等优异的综合性能,因而应用前景十分广 阔<sup>[1]</sup>。目前,高熵合金的制备方法主要有真空电弧熔 炼法、粉末冶金法及激光增材制造。相较于传统制造 方法,激光增材制造技术具有加工柔性好和加工精度 高等优点。但是,受激光能量分布和马兰戈尼反向对 流的影响,凝固的金属颗粒在相邻轨道之间聚集,增材 件易出现表面球化,这将严重影响增材件的可靠性和 耐久度<sup>[2]</sup>。

为解决高熵合金增材件表面存在的沟壑、球化以 及凹坑等缺陷<sup>[36]</sup>,改善其表面粗糙度,国内外学者对 高熵合金增材件的可加工性进行了系统研究。东北大 学的巩亚东团队<sup>[79]</sup>对FeCoCrNi基高熵合金的磨削机 理、特性及工艺进行了系统研究;Guo等<sup>[10]</sup>采用铣磨复 合工艺提高了选择性激光增材制造CoCrFeMnNi高熵 合金的表面质量;Litwa等<sup>[11]</sup>比较了不同铣削参数下 CrMnFeCoNi高熵合金增材件的表面粗糙度和刀具磨 损情况;Lindner等<sup>[12]</sup>进一步对车削加工激光增材制造 高熵合金涂层的表面形貌和性能进行了研究。目前, 高熵合金增材件表面的加工工艺仍以传统的机械加工 为主,这种加工方式存在刀具磨损、表面易划伤、复杂 件难加工等问题。

激光抛光技术是一种新型的材料表面抛光技 术,具有加工质量高、材料适应性广以及加工效率 高等优点[13],可有效解决以上问题,已被广泛应用于 Inconel 718、铝合金及 Ti6Al4V 等传统合金增材件的 表面加工上。Liu等<sup>[14]</sup>采用脉冲与连续复合激光抛光 工艺,将Inconel 718合金增材件表面粗糙度降低至 0.23 μm; Temmler等<sup>[15]</sup>采用多步连续激光抛光工艺对 H11钢表面进行重熔抛光,结果表明,使用多步抛光工 艺可将试样的表面粗糙度降至0.05 μm; Tian 等<sup>[16]</sup>采 用连续激光抛光工艺将 Ti6Al4V 增材件的表面粗糙 度从原始的 21.46 µm 降至 0.51 µm, 同时, 改善了增材 件表面高应力集中现象;Rombouts等<sup>[17]</sup>研究了连续激 光抛光过程中表面倾角与扫描策略对316L增材件表 面粗糙度的影响,结果表明,采用一定的倾角和扫描策 略可以显著提升增材件的表面质量,使其表面粗糙度 由 5 μm 减小至 1.5 μm。此外, Zhang 等<sup>[18]</sup>采用双低功 率激光抛光系统进行了抛光实验,双低功率激光抛光 在提高抛光质量的同时避免了表面材料的蒸发,进一 步拓展了激光抛光技术的材料适应性。

收稿日期: 2023-03-14; 修回日期: 2023-03-31; 录用日期: 2023-05-15; 网络首发日期: 2023-05-25

**基金项目**: 宁波市"科技创新2025"重大项目(2022Z073)、浙江省自然科学基金(LY20E050004)、宁波市自然科学基金重点项目(2022J291)、浙江省重点研发计划(2020C01036)

通信作者: \*zhangmina@nimte.ac.cn; \*\*chenxiaoxiao@nimte.ac.cn

#### 第 50 卷 第 20 期/2023 年 10 月/中国激光

综上所述,激光抛光技术对增材结构件表面质量 具有明显的改善效果,但鲜有对高熵合金增材件表面 质量进行研究的公开报道。鉴于此,笔者采用连续激 光对 CoCrFeNi高熵合金增材件表面进行抛光实验, 研究了工艺参数对高熵合金增材件表面粗糙度的影响 规律,分析了抛光后高熵合金表面微观组织结构变化 的机理。本研究可为高熵合金增材件激光抛光工艺参 数优化提供工艺支撑。

# 2 实 验

## 2.1 激光增材制造高熵合金

实验原料为CoCrFeNi高熵合金预合金粉末。采 用扫描电子显微镜(SEM)观察CoCrFeNi高熵合金粉 末的微观形貌,粉末颗粒呈典型的球状,如图1(a)所示。粉末颗粒的截面如图1(b)所示,粉末中各元素的含量如表1所示。CoCrFeNi高熵合金粉末的粒径统计分析表明粒径具有正态分布特征,粒径分布在45~105  $\mu$ m之间,平均粒径为77.12  $\mu$ m,如图1(c)所示。激光增材制造系统包括连续光纤激光器(Rofin FI040,最大激光功率 $P_L$ =4000 W,激光波长 $\lambda$ =1060 nm)、六轴KuKa机器人及激光熔覆头,如图2(a)所示。图2(b)为激光增材制造过程示意图。实验前,先将合金粉末置于干燥箱中干燥3h,并使用角磨机对基板进行打磨。采用优化后的工艺参数制备尺寸为50 nm×60 mm×5 mm 的CoCrFeNi高熵合金试样,合金试样的表面粗糙度为21.52  $\mu$ m。





表1 CoCrFeNi高熵合金粉末中各元素的含量

Table 1	Content	of	each	element	in	CoCrFeNi	high-entropy
allov powder							

2	anoy powder			
Element	Atomic fraction / %			
Cr	26.12			
Fe	24.63			
Со	24.59			
Ni	24.65			

#### 2.2 连续激光抛光实验

激光抛光实验使用的实验平台为连续光纤激光加 工系统,如图 2(c)所示。连续光纤激光加工系统由一 台连续激光器(RFL-C1000W,最大激光功率  $P_L$ = 1000 W,激光波长 $\lambda$ =1060 nm,光斑直径 D=100  $\mu$ m) 和一台扫描振镜组成。抛光之前,先将 CoCrFeNi 高 熵合金增材件固定在运动平台上,并向气氛保护舱 内充入氩气,使舱内氧气含量降至 714.3 mg/m<sup>3</sup>以

下。图 2(d)为连续激光抛光示意图。在激光抛光过 程中,激光束沿预设路径移动(单向或正交),如图 3 所 示。抛光后采用VK 200激光共聚焦显微镜观察表面 形貌并统计表面粗糙度。



- 图 2 激光增材制造及连续激光抛光。(a)激光增材制造系统;(b)激光增材制造过程示意图;(c)连续激光抛光系统;(d)连续激光抛 光过程示意图
- Fig. 2 Laser additive manufacturing and continuous-wave (CW) laser polishing. (a) Laser additive manufacturing system; (b) schematic diagram of laser additive manufacturing process; (c) continuous-wave laser-polishing system; (d) schematic diagram of continuous-wave laser-polishing process





图 3 扫描策略。(a)单向扫描;(b)正交扫描 Fig. 3 Scanning strategies. (a) Uni-directional scanning; (b) orthogonal scanning

首先采用因素筛选实验法分析各因素对 CoCrFeNi高熵合金增材件表面粗糙度的影响程度,而 后基于因素筛选实验结果进行单因素实验。影响 CoCrFeNi高熵合金增材件表面加工质量的因素主要 有激光功率(P<sub>L</sub>)、扫描速度(V)、扫描间距(d)、离焦 量(z)、加工次数(n)以及扫描策略(S<sub>p</sub>)。选择以上6 个因素作为筛选实验因素,在每个因素的取值范围 内各取2个水平,各因素在两个水平下的具体取值 情况如表2所示。采用Minitab软件选取1个仿行和 2个中心点创建明确筛选设计。

Table 2Experimental factors and levels						
Footor	Level					
r actor	1	2				
Laser power $P_{\rm L}$ /W	150	300				
Scanning speed $V / (mm \cdot s^{-1})$	300	1000				
Scanning pitch $d/\mu m$	5	150				
Defocus <i>z</i> /mm	0	10				
The number of scanning $n$	2	8				
Scanning strategy $S_{\text{p}}$	Uni-directional scanning	Orthogonal scanning				

表2 实验因素与水平

# 3 结果与讨论

## 3.1 影响因素筛选实验

参照表2设置的实验参数进行连续激光抛光实验,使用激光共聚焦显微镜测量每个参数下高熵合金 增材件的表面粗糙度(R<sub>a</sub>),测量结果如表3所示。采 用方差分析法对实验结果进行分析,分析结果如表4 所示。从表4中可以看出,模型主效应是显著的(显著 水平取0.10,主效应P值为0.002,2-因子交互效应P值 为0.001)。从单个因子效应的检验可以看出,主效应 中的因子V(扫描速度)效应不显著(P值为0.12),因 子S<sub>p</sub>(扫描策略)效应不显著(P值为0.234),因子n(扫 描次数)效应不显著(P值为0.773),其余因子效应均 为显著。但是,激光功率与离焦量、激光功率与扫描次 数、扫描速度与扫描间距之间存在显著的交互作用, 如图4所示。从图4可以看出,离焦量z的影响程度最 大,之后依次为激光功率P<sub>L</sub>、扫描间距d、扫描速度V、 扫描策略S<sub>b</sub>、扫描次数n。因此,在单因素实验中不考

表3 筛选实验结果

Гab	le 3	Screening	test	resul	ts
-----	------	-----------	------	-------	----

Number	Surface roughness $R_{\rm a}$ /µm	Standard error $/\mu m$
1	12.95	1.30
2	13.76	0.72
3	15.99	1.38
4	15.43	0.62
5	5.29	0.42
6	12.54	1.10
7	4.51	0.35
8	16.15	0.76
9	9.88	0.65
10	19.48	0.54
11	9.00	0.63
12	11.42	1.16
13	20.20	1.06
14	10.92	0.57

表4 CoCrFeNi高熵合金方差分析

Γable 4 Variance analysis of CoCrFeNi high-entropy allo
---

Item	Degree of freedom	Adj SS	Adj MS	F value	P value
Model	9	278.76	30.9733	36.51	0.002
Linear	6	124.492	20.7487	24.46	0.004
$P_{\text{L}}$	1	10.873	10.8727	12.82	0.023
V	1	3.3	3.3001	3.89	0.12
d	1	7.717	7.7165	9.1	0.039
z	1	97.68	97.6799	115.15	0
$S_{ m p}$	1	1.667	1.6669	1.97	0.234
n	1	0.081	0.0807	0.1	0.773
2-factor interaction	3	154.267	51.4225	60.62	0.001
$P_{L}$ •z	1	87.873	87.8727	103.59	0.001
$P_{L} \cdot n$	1	63.021	63.0206	74.29	0.001
$V \cdot d$	1	10.392	10.3918	12.25	0.025
Error	4	3.393	0.8483		
Summation	13	282.153			





虑扫描策略对表面粗糙度的影响,将其统一为单向扫描,如图3(a)所示。

## 3.2 离焦量对表面粗糙度的影响

离焦量指的是激光焦点到样品表面的距离。如图5 所示,当焦点在样品表面时,离焦量为0;当焦点在样 品表面以上时,为正离焦;当焦点在样品内部时,为负 离焦。离焦量越大,样品表面的光斑直径也就越大,两 者之间的关系<sup>[19]</sup>为

$$D = D_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_{\rm R}}\right)^2}, \qquad (1)$$



图 5 离焦量示意图 Fig. 5 Defocus schematic

其中,

$$z_{\rm R} = \frac{\pi D_0}{4\lambda},\tag{2}$$

式中:D为光斑直径;D<sub>0</sub>为腰斑直径;z为离焦量;z<sub>R</sub>为 瑞利长度;λ为激光波长。

为探究离焦量对激光抛光效果的影响,在 $P_{L}$ =400 W、V=300 mm/s、n=6、d=0.05 mm的条件下,改变离焦量,如表5所示。离焦量对CoCrFeNi高熵合金增材件表面粗糙度的影响规律如图6所示。激光抛光表面在激光共聚焦显微镜下的形貌如图7 所示。

表5 实验工艺参数

Table 5Experimental process parameters						
Number	Laser power $P_{ m L}$ /W	Scanning speed $V / (\text{mm} \cdot \text{s}^{-1})$	The number of scanning <i>n</i>	Scanning pitch <i>d</i> /mm	Defocus z /mm	
1		300	6	0.05	0	
2	400				2	
3	400				4	
4					6	



图 6 离焦量对 CoCrFeNi 高熵合金增材件表面粗糙度的影响 规律

Fig. 6 Influence of defocus on surface roughness of CoCrFeNi high-entropy alloy additive samples

由图 6 可知, 抛光样品的表面粗糙度随离焦量的 增加呈先减小后增大的趋势。研究发现, 在抛光过程 中,毛细管力的作用是平滑熔池表面,而热毛细管力的 作用是驱动熔池中熔体流动<sup>[20]</sup>。当离焦量较小时,激 光能量密度较为集中,热毛细管力对流体的驱动作用 大于毛细管力,使熔池内的熔融材料从熔池周边向熔 池中心流动,从而形成部分凸起。在高能量密度的激 光束作用下,熔池内的熔体受热蒸发,产生金属蒸气, 在金属蒸气压力的作用下部分熔体向外喷溅,在熔道 两侧形成堆积物,如图7(a)所示。当扫描间距一定 时,离焦量的改变会影响激光光斑的有效重叠率。因 此,当离焦量适中时,激光光斑能量密度分布更为均 匀,熔道两侧形成的堆积物减少,凸起高度减小,表面 粗糙度较低,如图7(b)所示;当离焦量过大时,光斑搭 接处的表面材料吸收的激光能量较少<sup>[21]</sup>,材料不足以 充分熔化和流动,在搭接处形成新的凸起,抛光轨迹更 为清晰,从而使得表面粗糙度较大,如图7(d)所示。



图7 不同离焦量下激光抛光表面的三维形貌图。(a)0 mm;(b)2 mm;(c)4 mm;(d)6 mm



#### 3.3 激光功率与扫描速度对表面粗糙度的影响

激光能量密度(L<sub>et</sub>)指熔融过程中激光能量传递的多少<sup>[22]</sup>,主要与激光功率、扫描速度及激光光斑直径相关,可表示为



为探究激光功率与扫描速度对激光抛光表面粗 糙度的影响,在z=0 mm、d=0.005 mm/0.01 mm/ 0.05 mm、n=2次时,改变激光功率与扫描速度,进行 抛光实验。得到了激光抛光样品表面粗糙度的变化规 律,如图8所示。不同激光功率与扫描速度下抛光表 面的三维形貌如图9和图10所示。



图 8 表面粗糙度随激光功率和扫描速度的变化规律。(a)表面粗糙度随激光功率的变化;(b)表面粗糙度随扫描速度的变化 Fig. 8 Variation of surface roughness with laser power and scanning speed. (a) Variation of surface roughness with laser power; (b) variation of surface roughness with scanning speed

由图 8(a)可知:在扫描速度(V=300 mm/s)不变的条件下,当扫描间距为0.005 mm时,样品表面粗糙度随着激光功率的增加而减小;当扫描间距为0.01 mm时,样品表面粗糙度随着激光功率的增加呈先增大后减小的趋势;当扫描间距为0.05 mm时,随着激光功率从 200 W 增加至 400 W时,样品表面粗糙度的变化幅度较大,降幅约为66%。由式(3)可知,当光斑直径不变时,激光功率与能量密度成正比,扫描速度与能量密

度成反比。因此,结合图 8 中表面粗糙度的变化规律 可知:当扫描间距为 0.01 mm 时,样品表面粗糙度随着 能量密度的增加呈先增大后减小的趋势;当扫描间距 为 0.05 mm 时,样品表面粗糙度随着能量密度的增加 而减小。

如图 9(a)、(b)所示,当激光功率(P<sub>L</sub>=200 W)较小时,熔覆的波纹特征明显,表面并未得到有效平滑。随 着激光功率增加,熔覆轨迹逐渐消除,表面起伏程度减





小。这主要是因为随着激光功率增加,热效应熔融表 层材料实现平滑的机制由表面浅熔融逐渐转变为表面 过熔融。当激光功率较小时,作用在样品表面的能量 密度较小,熔池较浅,熔融金属在重力、表面张力的作 用下向凹陷处流动,但因温度低和快速冷却作用,熔体 无法充分流动,导致样品表面形成了新的凸起。随着 激光功率增加,材料表面熔池温度升高且熔池深度增 大,熔融金属在短时间内得到充分流动,样品表面趋于 光滑平整。图9(c)、(e)显示,抛光表面的波峰高度明 显下降,粉末黏附现象消失,形成了离散的凸起与大面 积凹陷,该凹陷的宽度大于原始表面熔覆道沟壑的 宽度,但其深度小于原始表面熔覆道沟壑的深度。 图 9(d)显示,激光作用后,样品表面形成了新的连续 性大面积凸起,凸起高度大幅度降低。产生该现象的 主要原因是初始表面熔融金属粉末流动不充分。在激 光作用下,增材件表面的材料吸收激光能量,实现"熔 峰去谷"效应。表面黏附的金属粉末吸收激光能量后 熔化,在重力的作用下于抛光表面流动铺展,趋于平 整,并快速熔于抛光后的表面。但是在凝固过程中,熔 融金属会受到黏性力的影响,难以在材料凝固之前完 全平整,从而导致了新的大面积凸起。

由图 8(b)可知:在激光功率( $P_1$ =300 W)不变 的条件下,当扫描间距为0.005 mm时,随着扫描速 度增大,样品表面粗糙度变化不显著;当扫描间距为 0.01 mm时,样品表面粗糙度随着扫描速度的增大呈 现出先减小后增大的趋势;当扫描间距为0.05 mm 时,样品表面粗糙度随着扫描速度的增大而增大,增 幅约为166%;当扫描速度为300 mm/s时,样品表面 粗糙度随着扫描间距的增加呈先增大后减小的趋势; 当扫描速度大于 300 mm/s时,样品表面粗糙度随着 扫描间距的增加而增大,且增幅随着扫描间距增大而 逐渐增大。由图10可知,随着扫描速度和扫描间距 增大,初始表面黏附粉末和波纹度的去除效果较弱。 当扫描速度从300 mm/s提升至800 mm/s时,激光能 量密度减少至初始的37.5%,样品表面材料吸收的激 光能量不足,导致热量无法传导至材料内部,熔池深 度减小[23],表面波峰与凸起首先熔融,然后在重力、表 面张力的作用下流向波谷,未流至波谷时快速凝固





形成新的凸起,如图 10(c)所示;当扫描速度升至 1300 mm/s时,随着扫描间距从 0.005 mm 增大至 0.05 mm,材料表面吸收的激光能量不足,熔融金属 材料的黏性增大,不易发生马兰戈尼效应驱动的热毛 细流动<sup>[24]</sup>,导致熔覆路径去除不明显;如图 10(b)、 (d)所示,激光扫描路径搭接处的激光能量不足,无法 形成有效熔池,导致搭接区域凸起;在较小的激光能 量下,搭接处粉末的外部首先开始熔融,并在重力作 用下熔入抛光表面,粉末在尚未完全熔融时凝固,形 成新的半球形凸起,如图 10(e)、(f)所示。

#### 3.4 扫描次数对表面粗糙度的影响

为探究扫描次数对激光抛光效果的影响,在 $P_{\rm L}$ = 400 W、V=300 mm/s、d=0.05 mm、z=+2 mm 的条 件下,改变扫描次数进行实验。扫描次数对增材件表 面粗糙度的影响规律如图 11 所示,图 12 为不同扫描次 数下激光抛光表面的三维形貌图。

由图11可知,激光抛光后增材件表面粗糙度随扫



- 图 11 扫描次数对 CoCrFeNi高熵合金增材件表面粗糙度的影响规律
- Fig. 11 Influence of the number of scanning on surface roughness of CoCrFeNi high-entropy alloy additive samples

描次数的增加呈先增大后减小然后再增大的趋势。如 图 12 所示,抛光表面存在明显的激光扫描轨迹。当扫



图 12 不同扫描次数下的三维形貌图。(a)n=4;(b)n=6;(c)n=8;(d)n=10Fig. 12 Three-dimensional topography at different numbers of scanning. (a)n=4; (b)n=6; (c)n=8; (d)n=10

描次数为2次(n=2)时,在激光的作用下,增材件表 面的波纹与粉末被消除,粗糙度大幅度下降,但扫描 次数较少,熔融材料无法充分流动并在激光扫描轨迹 两侧堆积,激光扫描轨迹明显,如图9(f)所示。当扫 描次数增加至4次(n=4)时,熔融道两侧凸起材料受 热熔化,并在表面张力、重力的作用下向凹槽处流动, 部分熔融金属材料未能得到充分流动,在凹槽中形成 新的横向台阶,表面部分区域的粗糙度小幅度上升 (约为0.12 μm),如图12(a)所示。当扫描次数为6次 (n=6)时,材料表面得到了充分的平滑,抛光效果最 佳。随着扫描次数继续增加,之后的多次扫描在光滑 表面上进行,部分飞溅物在光滑表面堆积,并且激光能 量不断累积导致材料表面温度分布不均<sup>[25]</sup>,部分区域 出现过热现象,温度从激光扫描路径中心向两端降低。 对于大多熔融的液态金属来说,表面张力随着温度的 升高而降低,因此扫描路径两端材料的表面张力较大, 熔融金属材料倾向于向外流动,在扫描路径中心处形 成凹陷<sup>[26]</sup>,导致抛光表面局部区域存在明显的大面积 凹陷,如图12(d)所示。

#### 3.5 激光抛光前后的微观结构分析

使用 Quanta 250 场发射扫描电镜(SEM)和 X 射 线衍射仪(XRD)对 CoCrFeNi高熵合金增材件原始表 面与抛光表面(P=400 W,V=300 mm/s,d=0.05 mm, z=6 mm,n=6)进行微观形貌、能谱(EDS)分析以及 物相表征,结果如图 13 和图 14 所示。由图 13(a)可 知,样品初始表面存在不规则的凸起,增材过程形成 了沟壑以及未熔金属粉末。经激光抛光后,样品表面 光滑平整,改变了原始表面形貌。由图 13(b)可知,



图13 样品的表面形貌及X射线衍射谱。(a)样品原始表面;(b)抛光前后样品的X射线衍射谱

Fig. 13 Surface morphology and X-ray diffraction patterns of the samples. (a) Initial surface of the sample; (b) X-ray diffraction patterns of the sample before and after polishing

#### 第 50 卷 第 20 期/2023 年 10 月/中国激光

CoCrFeNi高熵合金抛光前后衍射峰角度相同,原始 表面和抛光表面均为面心立方(FCC)结构,未产生新 的固溶体结构。激光抛光后,抛光层出现晶体择优 取向。 增材件原始表面各元素的分布较为均匀,存在部 分氧化现象,但CoCrFeNi高熵合金增材件的氧化行 为仅局限于近表面区域。对原始表面与抛光表面进行 线扫描分析,扫描结果如图14所示。结果显示,





CoCrFeNi高熵合金增材件原始表面富集O元素和Cr 元素,Co元素和Fe元素的含量居中,Ni元素含量较 少。研究显示<sup>[27]</sup>,在Co、Cr、Fe、Ni这4种元素中,O元 素与Cr元素的亲和力最大,与Ni元素的亲和力最小, 与Fe、Co的亲和力相似且亲和力居于上述两者之间。 在激光增材制造过程中,由于热量的累积,即使是在氩 气环境中,气体的对流作用也会使少量的氧气流向材 料表面,在激光的作用下与材料表面的Cr元素反应, 生成铬类氧化物,如图15(a)所示。由此可以推测,在

#### 第 50 卷 第 20 期/2023 年 10 月/中国激光

激光作用下,材料表面可能生成了 Cr<sub>x</sub>O<sub>y</sub>和 FeO 等金 属氧化物,且主要以 Cr<sub>x</sub>O<sub>y</sub>为主。而对于抛光后的材料 表面,O元素和 Cr元素含量出现了明显的下降,这是 由于激光作用过程中钝化膜遭到了破坏<sup>[28]</sup>。抛光表面 元素分布得更为均匀,无元素偏析现象,表面平整度得 以提升。如图 15(b)所示,在高能量密度的激光束作 用下,原始表面的大部分氧化物快速蒸发,少量未蒸发 的氧化物发生分解或是在熔池的涌动下被掩盖于材料 近表层中。



#### 图 15 样品表面氧化层形成和去除示意图。(a)氧化层形成示意图;(b)氧化层去除示意图

Fig. 15 Schematic diagrams of oxide layer formation and removal on sample surface. (a) Schematic diagram of oxide layer formation; (b) schematic diagram of oxide layer removal

# 4 结 论

采用连续激光对 CoCrFeNi 高熵合金增材件表面 进行抛光实验,以提高表面平整度,研究了激光功率、 扫描速度、扫描间距、离焦量以及扫描次数对抛光效果 的影响,同时分析了连续激光抛光对表面形貌、元素分 布的影响。

连续激光对 CoCrFeNi 高熵合金增材件表面材料 的主要作用机制是:样品表面黏附的粉末、凹凸部分材 料吸收激光能量后瞬间熔化,熔融金属在重力、表面张 力的作用下向凹陷处流动,实现"削峰填谷";材料表层 氧化层在高能量密度激光作用下瞬间汽化,少部分熔 融氧化物在熔池的涌动下被填埋于重铸层中或是残留 在材料表面。

影响CoCrFeNi高熵合金增材件表面抛光效果的 因素主要有激光功率、扫描速度、扫描间距、离焦量以 及扫描次数,这5个因素中的离焦量对表面粗糙度的 影响程度最大,之后依次是激光功率、扫描间距、扫描 速度、扫描次数。

激光功率与扫描速度改变了激光能量密度,使熔 池状态发生改变,最终影响了表面粗糙度。表面粗糙 度随着激光功率的增大而减小,随着扫描速度、离焦 量、扫描次数的增加总体呈先减小后增大的趋势。当 P<sub>L</sub>=200 W时,表面粗糙度随着扫描间距增加呈先减 小后增大的趋势;当P<sub>L</sub>>300 W时,表面粗糙度随着扫描间距增加呈先增大后减小的趋势。CoCrFeNi高熵 合金增材件初始表面存在部分氧化,形成了以铬化物 为主的氧化物,抛光后材料表面的O元素和Cr元素含 量明显降低,而Co元素、Fe元素、Ni元素含量有所提 升,氧化层被去除,表面粗糙度降低。当 $P_{\rm L}$ =400 W、 V=300 mm/s、d=0.05 mm、z=+2 mm、n=6次时, 表面粗糙度最小,相比原始表面粗糙度降低了90%。

#### 参考文献

- Zhang W R, Liaw P K, Zhang Y. Science and technology in highentropy alloys[J]. Science China Materials, 2018, 61(1): 2-22.
- [2] Yue H T, Lü N, Guo C G, et al. Microstructure evolution and defect characteristics of multilayer Fe-Cr alloy coatings fabricated by laser melting deposition[J]. Optics & Laser Technology, 2023, 158: 108802.
- [3] Oyelola O, Crawforth P, M'Saoubi R, et al. Machining of additively manufactured parts: implications for surface integrity[J]. Procedia CIRP, 2016, 45: 119-122.
- [4] 陈路林,王成,刘强,等.工艺参数对H13钢表面激光熔覆高熵 合金成型和性能的影响[J]. 焊管,2022,45(3):13-19. Chen L L, Wang C, Liu Q, et al. Effect of process parameters on forming and properties of laser cladding high-entropy alloy on H13 steel surface[J]. Welded Pipe and Tube, 2022, 45(3): 13-19.
- [5] Shang F M, Chen S Y, Zhou L, et al. Effect of laser energy volume density on wear resistance and corrosion resistance of 30Cr15MoY alloy steel coating prepared by laser direct metal deposition[J]. Surface and Coatings Technology, 2021, 421: 127382.
- [6] Guo C, Li S, Shi S, et al. Effect of processing parameters on surface roughness, porosity and cracking of as-built IN738LC parts fabricated by laser powder bed fusion[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2020, 285: 116788.
- [7] 张唤.高熵合金的机械加工及实验研究[D]. 沈阳:东北大学,

#### 第 50 卷 第 20 期/2023 年 10 月/中国激光

研究论文

2017.

Zhang H. Research on the mechanical processing and experiment of high-entropy alloy[D]. Shenyang: Northeastern University, 2017.

- [8] 刘寅. 块体金属玻璃与高熵合金微磨削特性及工艺基础实验研 究[D]. 沈阳: 东北大学, 2018.
   Liu Y. Experimental investigations on micro grinding
- characteristics and technological basis of bulk metallic glasses and high-entropy alloys[D]. Shenyang: Northeastern University, 2018.
  [9] 于兴晨.高熵合金的磨削机理及磨削表面质量研究[D]. 沈阳:东

北大学, 2020. Yu X C. Research on grinding mechanism and surface quality of high-entropy alloys[D]. Shenyang: Northeastern University, 2020.

- [10] Guo J, Goh M H, Zhu Z G, et al. On the machining of selective laser melting CoCrFeMnNi high-entropy alloy[J]. Materials &. Design, 2018, 153: 211-220.
- [11] Litwa P, Hernandez-Nava E, Guan D K, et al. The additive manufacture processing and machinability of CrMnFeCoNi highentropy alloy[J]. Materials & Design, 2021, 198: 109380.
- [12] Lindner T, Liborius H, Töberling G, et al. High-speed laser metal deposition of CrFeCoNi and AlCrFeCoNi HEA coatings with narrow intermixing zone and their machining by turning and diamond smoothing[J]. Coatings, 2022, 12(7): 879.
- [13] 刘二举,徐杰,陈曦,等.激光抛光技术研究进展与发展趋势[J].
   中国激光, 2023, 50(16): 1602202.
   Liu E J, Xu J, Chen X, et al. Advancements and developments of laser polishing technology[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50 (16): 1602202.
- [14] Liu Y F, Ouyang W T, Wu H C, et al. Improving surface quality and superficial microstructure of LDED Inconel 718 superalloy processed by hybrid laser polishing[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2022, 300: 117428.
- [15] Temmler A, Liu D, Preußner J, et al. Influence of laser polishing on surface roughness and microstructural properties of the remelted surface boundary layer of tool steel H11[J]. Materials & Design, 2020, 192: 108689.
- [16] Tian Y T, Gora W S, Cabo A P, et al. Material interactions in laser polishing powder bed additive manufactured Ti6Al4V components[J]. Additive Manufacturing, 2018, 20: 11-22.
- [17] Rombouts M, Maes G, Hendrix W, et al. Surface finish after laser metal deposition[J]. Physics Procedia, 2013, 41: 810-814.
- [18] Zhang W X, Wong K, Morales M, et al. Implications of using two low-power continuous-wave lasers for polishing[J]. International Journal of Extreme Manufacturing, 2020, 2(3): 035101.

- [19] 车科,刘俨后,秦继鹏,等.连续激光抛光9CrWMn模具钢工艺 参数研究[J].工具技术,2022,56(8):25-29.
  Che K, Liu Y H, Qin J P, et al. Research on process parameters of continuous laser polishing of 9CrWMn mould steel[J]. Tool Engineering, 2022, 56(8):25-29.
- [20] Xu J L, Zou P, Kang D, et al. Theoretical and experimental study of bulge formation in laser polishing of 304 stainless steel[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 66: 39-52.
- [21] 黄旭东,王涛,胡少武,等.基于正交试验和响应面法的激光抛 光参数优化[J].激光与光电子学进展,2022,59(11):1114004.
  Huang X D, Wang T, Hu S W, et al. Optimization of laser polishing parameters based on orthogonal experiment and response surface methodology[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(11):1114004.
- [22] He R, Wu M P, Cui C, et al. Effects of laser energy density on microstructure and corrosion resistance of FeCrNiMnAl highentropy alloy coating[J]. Optics & Laser Technology, 2022, 152: 108188.
- [23] 王梁,姜柯,范思远,等.低粗糙度表面的连续激光抛光形貌演 化机制研究[J].中国激光, 2023, 50(12): 1202106.
  Wang L, Jiang K, Fan S Y, et al. Morphology evolution mechanism of low-roughness surface polished by continuous laser
  [J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(12): 1202106.
- [24] Vadali M, Ma C, Duffie N A, et al. Pulsed laser micro polishing: surface prediction model[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2012, 14(3): 307-315.
- [25] 陈先游,陈晓晓,章玄华,等.镍基高温合金光束耦合纳秒激光 铣削表面成型质量研究[J].中国激光,2023,50(8):0802203. Chen X Y, Chen X X, Zhang X H, et al. Formed quality of milled surfaces of nickel-based superalloy by beam-coupled nanosecond laser[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(8): 0802203.
- [26] Ma C, Vadali M, Li X C, et al. Analytical and experimental investigation of thermocapillary flow in pulsed laser micropolishing [J]. Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2014, 2(2): 021010.
- [27] McKay F, Ismael T, Robinson A, et al. Surface oxidation mechanism of CoCrFeNi high-entropy alloy[J]. Surface Science, 2022, 723: 122124.
- [28] 李道齐,王涛,杨紫璠,等.304不锈钢激光抛光的参数优化及抛光层性能分析[J].中国激光,2023,50(4):0402021.
  Li D Q, Wang T, Yang Z F, et al. Optimization of laser polishing parameters of 304 stainless steel and performance analysis of polishing layer[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(4): 0402021.

# Surface Laser Polishing of High-Entropy CoCrFeNi Alloy Prepared by Laser Additive Manufacturing

Zhou Yuhang<sup>1,2,3</sup>, Zhang Mina<sup>2\*</sup>, Chen Xiaoxiao<sup>2\*\*</sup>, Zhang Qunli<sup>1,3</sup>, Zhang Wenwu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>College of Mechanical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China;
<sup>2</sup>Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences; Zhejiang Provincial Key Laboratory of Aero Engine Extreme Manufacturing Technology, Ningbo 315201, Zhejiang, China;
<sup>3</sup>Institute of Laser Advanced Manufacturing, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China

### Abstract

**Objective** High-entropy alloy additive parts face certain difficulties in maintaining surface quality and machining. As a new class of materials, their processing is inevitably different from that of conventional alloys in terms of material removal mechanisms and surface processing methods. To investigate the material removal mechanism of laser-polished high-entropy alloys and to solve the technical problems encountered in their processing and expand the scope of the laser processing system, this study investigated the continuous laser polishing of high-entropy alloy additive parts. The material removal mechanism and the influence of the laser-polishing parameters on the surface quality are analyzed to provide process support for the optimization of the laser-polishing process.

**Methods** A high-entropy CoCrFeNi alloy was used as the experimental material. First, the high-entropy alloy additive parts were prepared via laser additive manufacturing and then polished using a continuous laser under different processing parameters. Subsequently, their surface roughness was evaluated through laser confocal microscopy. The screening test method was used to determine the contribution of each influencing factor on the surface roughness, followed by the single-factor test method to analyze the influence of the process parameters such as defocus, laser power, scanning pitch, scanning speed, and the number of scanning on the surface roughness of the polished specimen. Finally, scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were used to analyze the material removal mechanism and the effect of laser polishing on the surface micromorphology and elemental distribution.

**Results and Discussions** The main factors that affect the surface polishing of the high-entropy CoCrFeNi alloy additive parts are defocus, laser power, scanning pitch, scanning speed, and the number of scanning (Fig. 4). The surface roughness of the polished sample tended to decrease at first and then increase with increasing defocus (Fig. 6). At a constant scanning speed (V=300 mm/s) and scanning pitch of 0.005 mm, the surface roughness decreased progressively with increasing laser power. At a scanning pitch of 0.01 mm, the surface roughness tended to increase and then decrease with increasing laser power, whereas it tended to decrease and then increase with increasing scanning speed (Fig. 8). At a scanning pitch of 0.05 mm, the surface roughness tended to increase and then decrease with increasing scanning speed (Fig. 8). At a scanning pitch of 0.05 mm, the surface roughness tended to increase and then decrease with increasing scanning speed. Further, at V=300 mm/s, the surface roughness tended to increase and then decrease with increasing scanning pitch. At V>300 mm/s, the surface roughness exhibited a progressively larger increase with increasing scanning pitch. Furthermore, the surface roughness of the laser-polished specimen tended to increase, then decrease, and then increase again as the number of scanning increased (Fig. 11). The O and Cr contents of the polished material decreased significantly, whereas the Co, Fe, and Ni contents increased (Fig. 15), and no new solid-solution structures were generated (Fig. 13). The surface roughness of the sample was reduced by 90% at the optimized polishing parameters ( $P_L=400 \text{ W}$ , V=300 mm/s, d= 0.05 mm, z=+2 mm, and n=6).

**Conclusions** In this study, laser polishing of a high-entropy alloy was performed using a continuous laser to investigate the influence of the process parameters on its roughness. And the study analyzes the mechanism of laser removal of high-entropy alloy surface materials. The surface material removal under continuous laser illumination mainly occurs through instantaneous melting or the evaporation of the surface material after the absorption of the laser energy, resulting in "peak and valley reduction." Some metal solutes form new protrusions on the surface under surface tension and gravity. The surface roughness of the sample decreases as the laser power increases, and it tends to decrease and then increase with increasing scanning speed, defocus, and scan cycles. During the laser-polishing process, the material surface undergoes complex physical and chemical reactions, and the surface elemental distribution changes.

Key words laser technique; continuous-wave lasers polishing; CoCrFeNi high-entropy alloy; surface roughness; surface topography